(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)作許出願公開番号

特開平5-154923

(43)公開日 平成5年(1993)6月22日

(51) Int.Cl. 5 E 2 9 C 65/78 65/48 B 4 1 F 17/14 G 0 2 F 1/13 # E 2 9 L 31:34	施別記号 庁内整理番号 2126-4F 2126-4F E 9112-2C 101 8806-2K 4F	F: 技術表示箇所 芸術表示箇所 等査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)
(21) 出願番号	特願平3-323138	(71) 出願人 000005108 株式会社日立製作所
(22) 出額日 平成3年(1991)12月6	平成3年(1991)12月6日	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (71)出願人 000233077 日立テクノエンジニアリング株式会社 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地
		(72)発明者 米田 福男 茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内
·		(74)代理人 弁理士 秋本 正実
		最終頁に統く

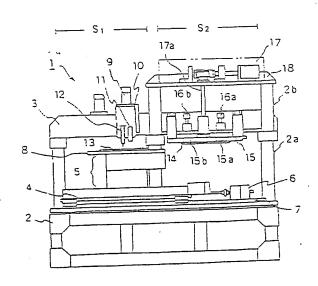
(54) 【発明の名称】 基板組立装置

(57)【耍約】

(目的) 組立作業中に整埃を取り込まずに基板同士を シール剤で貼り合わせることのできる装置を提供すること。

【構成】 シール剤描画ステーションS1と基板貼り台 わせステーションS2間を移動するテーブル4を設け、その上で値交方向に移動するステージ5に第1基板13を搭載し、S1でノズル先端を下方に向けて設けた吐出機12からシール剤を吐出させつつステージを直交方向に移動させてパターン描画し、S2で吸着テーブル15に第2基板14を水平吊下げ、テーブル4をS2に移動させて第1基板を第2基板の下方に配置し、両基板の対向間隔を狭めて貼り合わせる。

[図1] 本民明の一東池州(京7 放晶表示ドル組)を建 の正面図



【特許請求の範目】

【請求項1】 シール剤描画ステーションと基板貼り合 わせステーションとの間を移動可能なテーブルと、上記 シール剤措画ステーションに設けられシール剤を吐出す る先端が下方を向いたノズルと、上記テーブル上に設け られ第1の基板を搭載する少なくとも直交方向に移動可 能なステージと、上記ノズルからシール剤を吐出させつ つ上記ステージを直交方向に移動させることにより上記 第1の基板にシール剤を所望のパターンで措画させる手 段と、上記テーブルが上記基板貼り合わせステーション 10 に移動されたときに第2の基板を上記ステージに搭載さ れた上記第1の基板と平行でその上方になるように支持 する手段と、上記支持する手段で平行に配置された上記 第1と第2の両基板の対向間隔を挟めることにより両基 板をシール剤で貼り合わせる手段とを備えたことを特徴 とする基板組立芸置。

【請求項2】 請求項1記載の基板組立装置において、 上記ステージは搭載する第1の基板をさらに上下方向に 移動可能であることを特徴とする基板組立装置。

(請求項3] 請求項1記載の基板組立装置において、 その天并部と側周の一部とが網カバーで蔽われたことを 特徴とする基板組立芸置。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基板経立装置に係り、特 に液晶表示パネルのように2枚の基板を極めて接近させ 且つ組立作業中に塵埃を取り込まずに貼り合わすことが できる基板組立装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示パネルは透明電極や薄膜 トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数μm 程度の極めて接近した間隔をもってシール剤で貼り合わ し、それによって形成される密閉空間に液晶を封止した ものである。この液晶表示パネルのシール剤をガラス基 板に設ける手段として、ノズルから基板上に抵抗ペース トを吐出させつつ基板を移動させることにより所定のパ ターンを描画させて抵抗バターンを設ける技術を利用す ることができ、このような従来技術として特開平2-5 2742号公報に記載のものがある。また従来の液晶表 示パネルの基板の組立にあたってはシール剤を設けたガ ラス基板を搬送手段で貼り合わせ作業台に移し、そこで 手作業で2枚のガラス基板の面方向の位置合わせを行っ てから、スペーサとなる粒子等をシール剤に含ませてお くことによって数μm程度の極めて接近した間隔に2枚 のガラス基板を貼り合わせていた。

100031

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の液晶表 示パネルは微細な透明電極や薄膜トランジスタアレイが ガラス基板に設けられており、それによって構成される

にガラス基板上に塵埃が積もって密閉空間に塵埃が取り 込まれると、その塵埃の存在する箇所は画素欠陥とな り、モノクロ表示パネルでは欠陥部が黒点となり、また カラー表示パネルでは欠陥部が赤・緑・青のいずれかの 色となって、画面に表示される映像が見にくいものとな る。この液晶表示パネルのシール剤をガラス基板に設け る手段として、上記特開平2-52742号公報に記載 のものを利用すると、そこでは基板とノズルが非接触の 状態で抵抗ペーストを吐出させ、基板を移動させて所定 の抵抗パターンを描画させており、ノズルを固定してい ることによって基板上に塵埃が積りにくいものとなって いる。しかしながら、ここでは抵抗パターン描画後の基 板の取扱いについては格別言及されていない。また従来 の液晶表示パネルの上記基板の組立にあたってはシール 剤を設けたガラス基板を搬送手段で貼り合わせ作業台に 移し、手作業で2枚のガラス基板の位置合わせを行って から貼り合わせているため、その組立作業中にガラス基 板上に塵埃が積もって、密閉空間に塵埃が取り込まれる 度合いが非常に高いという問題があった。

【0004】本発明の目的は上記従来技術の問題点を解 決し、液晶表示パネルのように基板にシール剤を設けた のち2枚の基板を極めて接近させて貼り合わせる組立作 業中に塵埃を取り込まずに貼り合わすことができる簡単 な構成の基板組立芸置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の基板組立装置はシール剤描画ステーション と基板貼り合わせステーションとの間を移動可能なテー フルと、上記シール剤描面ステーションに設けられシー ル剤を吐出する先端が下方を向いたノズルと、上記テー ブル上に設けられ第1の基板を搭載する少なくとも直交 方向に移動可能なステージと、上記ノズルからシール剤 を吐出させつつ上記ステージを直交方向に移動させるこ とにより上記第1の基板にシール剤を所望のパターンで 描画させる手段と、上記テープルが上記基板貼り合わせ ステーションに移動されたときに第2の基板を上記ステ ージに搭載された上記第1の基板と平行でその上方にな るように支持する手段と、上記支持する手段で平行に配 置された上記第1と第2の両基板の対向間隔を狭めるこ とにより両基板をシール剤で貼り合わせる手段とを備え るようにしたものである。また上記基板組立芸蹟におい て、上記ステージが搭載する第1の基板をさらに上下方 向に移動可能にしたものであり、また基置の天井部と側 周の一部が網方バーで鼓われるようにしたものである。

[0006]

(作用) 上記基板組立装置はシール剤描画ステーション で上記ノズルからシール剤を吐出させつつ上記ステージ を直交方向に移動させつつ第1の茎板にシール剤パター ンを描画する工程で第1の基板の上部に動くものが存在 ール剤指画後に第1の基板がステージごと基板貼り合わ せステーションに移動して第2の基板の下方に配置され るため別の撤送手段が介在されないことと第1の基版の 上部で動くものが存在しないこととによって第1の基板 の移動する工程でも第1の基板上に塵埃が落下しない し、さらに両基板の貼り合わせ工程では上下で平行に配 置された両基板の対向間隔を決めることにより両基板が 貼り合わされるため両基板の間に動くものが存在しない ことによって第1の基板上に塵埃が落下しないし、この ように組立作業の如何なる工程でも第1の基板上に塵埃 が落下しないため両基板のシール剤による貼り合わせで 形成される空間内に塵埃が取り込まれることがなく、装 置の構成も簡単にできる。また上記ステージは搭載する 第1の基板をさらに上下方向に移動させることが可能で あることにより装置構成をさらに簡単にすることが可能 であり、さらに装置の天井部と側周の一部は編カバーで 厳われることによって装置をダウンフロー式クリーンル ームに置いて空気流で芸置内の豊埃が外部に排出され

[0007]

ā.

[実施例] 以下に本発明の一実施例を図1から図3によ り説明する。 図 1 は本発明による基板組立芸置の一実施 例を示す液晶表示パネル組立芸體の正面図である。図1 において、液晶表示パネル組立芸體 1 はシール剤描画ス テーションS1と、基板貼り合わせステーションS2と の2部分から構成され、この両ステーションS1, S2 は隣接して並べられている。基台2の上方に支柱2 a で 梁持された架台3があり、基台2の上面には両ステーシ ョンS1、S2に亘るレール?を備えている。このレー ル7上をステージ移動テーブル4がステージ駆動モータ 6 により、図面上で左右に即ち両ステーションS 1. S 2間を移動できるようになっている。テーブル4上には XY8ステージ5およびその上面で第1のガラス基板1 3 を真空吸着などにより支持する下側吸着テーブル8が 載置されている。ここで $oxed{X}oxed{Y}oldsymbol{ heta}$ ステージ $oxed{S}$ について説明 するに、第1のガラス基板13が水平に搭載されている とすると、第1のガラス基板13を水平にX軸・Y軸方 向に移動させるとともに、第1のガラス基板13を水平 に回転すなわち heta 軸移動させるものであり、もし第1の ガラス基板 1.3 がX Y 方向に正確に配置されるならば θ 軸移動は不要である。

[0008] 上記レール7と対面するシール剤描画ステ ーションS1部の架台3にはZ軸駆動モータ9によって 上下に移動する2軸移動テーブル10が設けられてい る。このテーブル10には光学式非接触変位計11とノ ズルを持つシール剤吐出機12とが取付けられており、 そのノズル先端は下方の第1のガラス基板13を向いて いる。一方の上記レール7と対面する基板貼り合わせス テーションS2部の架台3の上部には、さらに支柱2b で実持された架台18に加圧用駆動機構17が穀費さ 50 ル10上の光学式非接触変位計11の出力により図1の

れ、その下方に延びたボールねじ17aを介して該駆動 機構17で架台3の下側に設けられた加圧吸着テーブル 15を上下に移動するようになっている。この加圧吸着 テーブル15はその下面に第2のガラス基板14を上記 第1のガラス基板13と平行になるように真空吸着など により水平に吊り下げる形に支持するようになってい る。またこのテーブル15には2箇所に孔15a,15 bが穿けられており、このテーブル15に穿けられた孔 15a.15bに対応する架台3の部署にはCCD内蔵 の画像認識用カメラ16a, 16bが取付けられてい 10 る。この両カメラ16a,160は下方を向いており、 従ってカメラ16a,16bはテーブル15の両孔15 a.15bを通して第2のガラス基板14などの下部に 存在する物体を確認することができる。なおこの液晶衰 示パネル組立芸譚には上記した各駆動部の図示していな い制御芸置が設けられている。

{0009} 図2は図1の液晶表示パネル組立装置の動 作説明用の概略図である。つぎに図2により図1の液晶 表示パネル組立装置の動作および機能を説明する。なお 図2ではXY θ ステージ5 および下側吸着テーブル8を 貼り合わせステーションS.2に移動させた場合を2点鎖 線で示し、その各々に5φ,8φの符号を符した。図2 において、初めに貼り合わせステーションS2にステー ジ移動テーブル4が基台2上のレール7上を図1のステ ージ駆動モータ 6 により走行されると、XY heta ステージ 5 φ上の下側吸着テーブル 8 φ上にアダプタ 1 4 αを介 して第2のガラス基板14が載置される。このアダプタ 14 a は第2のガラス基板14の下面が下側吸着テープ ル8φに接触することを阻止するためのもので、第2の ガラス基板14の周縁を支持する額縁状のものである。 ここで両カメラ16a,16bで第2のガラス基板14 に設けられた図示していない位置合わせマークを読み取 りつつ、第2のガラス基板14が貼り合わせステーショ ンS2の所定位置に置かれるように $XY\theta$ ステージ 5ϕ を制御する。次いで図1の加圧用駆動機構17で加圧吸 着テーブル15を下方に移動させて、第2のガラス基板 14を該テーブル15で水平に吊り下げる形に吸着支持 し、そのまま駆動機構17で加圧吸着テーブル15を介 して第2のガラス基板14を上方に移動させて待機さ せ、そしてアダプタ14 a は除去される。この動作で整. 埃が遊離しても盥埃を避ける必要のない第2のガラス基 板14上面に落下するだけで何等の問題がない。

【0010】次に下側吸着テーブル8の上に第1のガラ ス基板13を載置し、そして第1のガラス基板13が貼 り合わせステーションS2の所定位置に置かれるように $XY\theta$ ステージ5 oを制御する。ここで第1のガラス基 板 13 の位置合わせが終わったら、今度は $XY\theta$ ステー ジ5ゥをシール剤措画ステーションS1に移動させる。 次にシール剤描画ステーションS1で、Z軸移動テーブ

Z 軸駆動モータ9を制御して、Z 軸移動テーブル10上 のシール剤吐出後12のノスル先端と下側吸着テーブル 8上の第1のガラス基板13上面とのギャップを設定す る。この動作でギャップ設定のためのシール剤吐出機1 2のノズル移動距離はわずかであり、これによる塵埃の 遊離は殆どない。また塵埃の遊離を極度に嫌う場合に は、図2中に1点鎖線で示すようにシール剤吐出機12 の2軸移動テーブル10を含む駆動部を密閉し、その密 閉空間を真空引きすればよい。そして $ext{XY}\, heta$ ステージ $ext{5}$ を所定の描画バターンに従ってXY方向に移動させつ 10 つ、シール剤吐出機12のノズルからシール剤を吐出さ せて、シール剤の第1のガラス基板13への塗布を行 う。この描きたいシール剤パターンは図示していない。 また図示していない制御装置で所謂バソコン措画バター ンを格納記憶させておくことによって、同じ措画バター ンを何枚もの第1のガラス基板13への塗布を行うこと が可能であり、また各納データの変更で各種の措画バタ ーンを得ることもできる。この動作でシール剤の吐出描 画中に第1のガラス基板13の上部で動くものが存在し ないため、第1のガラス基板13の上面への塵埃の落下 20 はない.

[0011] 次に該シール剤塗布終了後にXY θ ステー ジ5は再び貼り合わせステーションS2に移動されて、 初めに第2のガラス基板14を抱えた加圧吸着テーブル 15の真下に位置法めされる。この動作でも第1のガラ ス基板13は $XY\theta$ ステージ5および下側吸着テーブル 8 ごと第2のガラス基板14の下方に配置され、別の搬 送手段が介在されないことと第1のガラス基板13の上 部で動くものが存在しないことによって、第1のガラス 基板13の移動に際しても第1のガラス基板13の上面 30 に塵埃が落下しない。さらに別の搬送手段を必要としな いので簡単な装置構成となっている。次に両カメラ16 a, 16bの焦点を第1のガラス基板13の図示してい ない位置合わせマークに合わせ、両カメラ16a,16 5でマークを読み取りながら $XY\theta$ ステージ5 ϕ を駆動 制御して、第1のガラス基板13と第2のガラス基板1 4 との凡その位置合わせを行う。そして図1の加圧用駆 動機構17で加圧吸着テーブル15を下方に徐々に移動 させて、両カメラ16a、16bで第2のガラス基板1 4の図示していない位置合わせマークが読み取れるよう になったら、 $XY\theta$ ステージ 5ϕ を駆動制御して第1の ガラス基板13と第2のガラス基板14との正確な位置 ・合わせを行いつつ、加圧吸着テーブル15をさらに徐々 に下降させて2枚のガラス基板13,14をシール剤で 貼り合わせる。この動作で両ガラス基板13,14の貼 り合わせでは、両ガラス基板13、14の間に動くもの が存在しないことによって、第1のガラス基板13の上 面に塵埃が落下しない。以上のように組立作業の如何な る工程でも第1のガラス基板13の上面に塵埃が落下し ないため、両ガラス基板1.3,1.4のシール剤による貼50 れかに設けたものである。この態様はシール剤の固化の

り合わせで形成される空間内に盛埃が取り込まれること がない。また以上のシール剤描画工程と、基板貼り合わ せ工程と、そのシール剤描画と基板貼り合わせの両ステ ーション間の移動工程とは簡単なシーケンス制御で処理 できるので、図示していない制御装置により一連の動作 をプログラム化してパソコンで制御してもよい。

[0012] 図3は図1の液晶表示パネル組立芸置の外 題の斜視圏である。 図3において、図1の液晶芸示パネ ル組立芸置1の前面と戛面の下部には網カバー19,2 0 が設けられ、両側面には蔽いカバー21, 22が設け られ、 蔽いカバー 22の脇に各駆動部の図示していない 制御装置の制御パネル23が設置されている。また天井 には網カバー24が設けられ、前面の上部にはアクリル 製の透明カバー25が設けられて内部が見えるようにな っている。本液晶表示パネル組立装置1はダウンフロー 式クリーンルームに置かれ、矢印Aで示した空気が流さ れると、装置1に天井の網カバー24から入った空気は 矢印B,Cで示すように芸置1の前面と裏面の下部の網 カバー19,20から流出し、その空気流で装置1内の 塵埃は外部に排出される。

【0013】本基板組立芸置は以下の態様で実施でき る。第1の態様は図1の2軸移動テーブル10に代えて 2 軸移動テーブルを X Y θ ステージ 5 に設け、シール剤 描画ステーションS1部の架台3にノズルを持つシール 剤吐出機12および光学式非接触変位計11を直接固定 し、該2軸移動テーブルでシール剤吐出機12のノズル 先端と下側吸着テーブル8上の第1のガラス基板13と のギャップを設定するようにしたものである。この態様 はシール剤措画ステーションS 1では下側吸着テーブル 8に載置される第1の基板13の上方に可動部が全く存 むしないため、第1の基板13への塵埃の落下が皆無で ある。第2の態様は図1の基板貼り合わせステーション S 2 における加圧用駆動機構17および架台18を省略 し、架台3に第2の基板14の吸着テーブル15を直接 固定して、Ζ軸移動テーブルをXYθステージ5に設 け、該2軸移動テーブルで第2の基板14を上昇させて 吸着テーブル15に吸着固定し、また3枚の基板13, 14を貼り合わせるようにしたものである。この態様は 基板貼り合わせステーションS2では吸着テーブル15 の上方に可動部が全く存在せず、塵埃の第1の基板13 への落下が皆無であり、また加圧用駆動機構17と架台 18の省略により装置構成が一層簡略化できる。第3の 服様は基板吸着機能を $XY\theta$ ステージ 5に設けて、下側 吸着テーブル 8 を省略したものである。この態標はステ ージ移動テーブル 4 上に乗せられる部材が減少して、軽 量化によりステージ移動テーブル 4 の走行が軽快にな る。第4の監探はシール剤の固定化仕様に応じて、シー ル剤固化のための紫外線照射手段等をシール剤描画ステ ーションS1と基板貼り合わせステーションS2のいず ための別置きの差置を必要とせず、基置構成を簡略化で きる。

(0014)

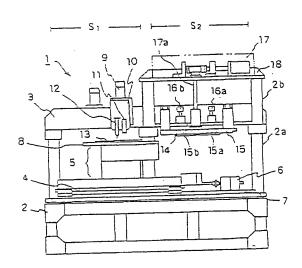
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、液 **晶表示パネルのように2枚の基板を接近させてシール剤** で貼り合わせる基板組立芸置での組立作業中に塵埃を取 り込まずに貼り合わすことができ、また基板組立芸置の 構成を簡単にできる効果がある。

(図面の簡単な説明)

示す液晶表示パネル組立装置の正面図

(図1)

[图]] 本兴明的一克拉州在天下和温安东作礼组立安置 の正面回



(図2) 図2は図1の動作説明用の環路図

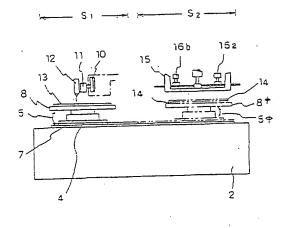
(図3) 図3は図1の外親の斜視図

(符号の説明)

S1…シール剤描画ステーション、S2…基板貼り合わ せステーション、4…ステージ移動テーブル、5…XY θステージ、7…レール、8…下側吸着テーブル、10 … 2 軸移動テーブル、11…光学式非接触変位計、12 …ノズルを持つシール剤吐出機、13…第1の基板、1 4…第2の基板、15…加圧吸着テーブル、16a, 1 【図1】図1は本発明による基板純立芸置の一実施例を 10 6 o…カメラ、1 7…加圧用駆動機構、1 9, 2 0, 2 4…絹カバー。

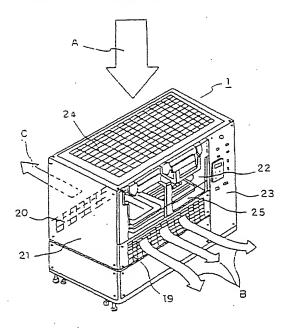
[図2]

[图2]图10到作影明用0摄形图



(図3)

[図3] 図1の外観料視図



フロントページの統き

(72)発明者 石田 茂

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 三階 春夫

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 近藤 克己

茨城県日立市久墓町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内